# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-177446

(43) Date of publication of application: 11.09.1985

(51)Int.CI.

**G11B** 7/24 B41M 5/26

G11C 13/04

(21)Application number: 59-031458

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP (NTT)

(22)Date of filing:

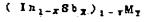
23.02.1984

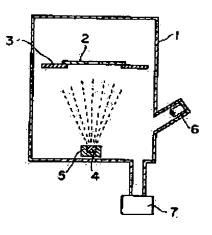
(72)Inventor: FUNAKOSHI NORIHIRO

## (54) OPTICAL DISK RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical disk recording medium which permits easy recording, reproducing, erasing and rerecording of information and has high phase stability of a recording state by forming an alloy layer consisting of In and Sb or In and Sb and a specific metal within a specific compsn. range. CONSTITUTION: The alloy film expressed by the formula (X is 55wt%<X<80 wt%, Y is 0wt%<Y<20wt%, M is ≥1 kinds selected from Au, Ag, Cu, Pd, Pt, Al, Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se and Bi) is deposited by evaporation on a substrate 2 consisting of polymethyl methacrylate, etc. by irradiating an electron beam from, for example, an electron beam generating source 6 on an alloy material 4 contained in a crucible 5. A protecting film consisting of fluoride such as MgF2, AlF3 or the like or oxide such as TeO3, TiO2 or the like is then provided on an alloy layer. The suitable selection of the compsn. between 120W160° C phase transition temp. of the alloy layer is thus





made possible. The recording medium which requires less writing energy and permits stable repeated erasing and writing in the recording phase is obtd.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 177446

(s) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号 A - 8421 - 5D 母公開 昭和60年(1985)9月11日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 G 11 C 13/04 A-8421-5D 7447-2H 7341-5B

審査請求 有

発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

光ディスク記録媒体

②特 願 昭59-31458

**20出 願 昭59(1984)2月23日** 

砂発 明 者 舩 越

宜博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

砂代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

明 細 養

1. 発明の名称

光ディスク記録媒体

2.特許請求の範囲

(1) 一般式

 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$ 

で表わされる組成の合金膜を記録層に有する ことを特徴とする光ディスク記録媒体。ただ し一般式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 重数 8 至 X 至 8 0 重数 8、

· 0 重量 5 至 Y 至 2 0 重量 5

であり、Mは Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 AL、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Biのう ちから遊んだ少くとも一 鞭を装わす。

(2) 一般式

( In 1 - x Sb x ) 1 - y M x

で表わされる組成の合金膜を記録層に有し、 さらに記録層上面に TeO2、 V2O3、 V3O6、 TiO2、 SiO2 などの段化物又は MgF2、CeF3、 A4F3 などの弗化物のうちから選んだ少くと も一種を保護膜として樹厳したことを特徴と する光デイスク記録媒体。ただし、一般式に おけるX、Yはそれぞれ

5 5 重旗 8 ≤ X ≤ 8 0 重量 8、

0 重量 5 ≤ Y ≤ 2 0 重量 5

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、 Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se およびBi の うちから選んだ少くとも一種を扱わす。

3. 発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は審き換え可能な、新規な暫き込み・再生用光ディスク記録媒体に関する。

く従来技術>

光ディスクは、当初情報に応じて基板上に形成した凹凸状ピット列を配録階とし、ピット列を光学的にピックアップして情報を再生するものであつた。しかし、固体の相転移を利用した配飲方式が開発されるに至り、単に再生するだけでなく、情報の母き込みおよびその再生の両者をレーザ先で行い、1ピットを約2μ角に書

## 特閒昭60-177446(2)

ると撥安定相(以下、「π相」という。)になるが、徐冷するときは、InSbとSbの混相
(平衡相)に転移し、しかもπ相にあるときは
混相のときの反射率よりも10~20多高くなるだけでなく、π相自体の安定性が高いことを
知つた。しかも、π相にある(In1-xSbx)1-yMy

み合金は相転移させることができ、独き込んだ
イ教を消去し、再替き込み(費き替え)が容易
であることを発見し、本発明を完成することが
できた。

### く発明の目的>

すなわち、本発明は情報の知き込み、その再生、消去が容易であると共に、 記録状態の相違と性が高く、 しかも繰り返し割き込み、 再生かよび消去が可能な光ディスク記録媒体を提供することを目的とする。

#### く発明の構成>

上記目的を達成するための本発明の光デイスク記録媒体は、一般式

(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-x</sub>M<sub>x</sub>
で表わされる組成の合金膜を配録層に有することを特徴とするものである。ただし、上記一般 式における X、 Y はそれぞれ

0 重世 男 ≦ Y ≦ 2 0 直近 男 であり、M は Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 Al 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Bi の う ちから送んだ少くとも 1 種を扱わす。

#### また、一般式

(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-r</sub>M<sub>y</sub> で表わされる組成の合金版を記録版に有し、さ らに記録励上面にTeO<sub>2</sub>、V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、V<sub>3</sub>O<sub>5</sub>、TiO<sub>2</sub>、 SiO<sub>2</sub> などの歐化物又はMgF<sub>2</sub>、CeF<sub>3</sub>、A∠F<sub>3</sub>な どの非化物のうちから選んだ少くとも一種を保 して役励したことをも特徴とするもので ある。ただし、一般式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 拡張 5 ≤ X ≤ 8 0 単批 5 、
0 重量 5 ≤ Y ≤ 2 0 重量 5

特問昭60-177446(3)

であり、M It Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 AL 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Bi のう ちから選んだ少くとも一種を殺わす。

上記一般式(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-y</sub>My 系合金は、Sb の添加量が 5 5 直量 5 より少なくなると概 1 図に示す範囲 B のごとく混相を形成し、 π 相 ( 無 1 図に示す A の範囲の組成のもの。 )を形成しなくなり、 8 0 進量 5 を終えると Sb の 単一相 c となり 温相を形成しなく なるため、 π 相 および 温相間の 相転移を利用した 情報の 報き込み、 再生および書き替えができなくなる。

(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-Y</sub>My系合金において、Myの添加性Yが20重性多を越えたときも合金はπ相を形成しなくなり、上述の場合と同じよりに相転移による情報の費き込み、再生および容きなえができなくなる。さらに、添加金銭M組成対相転移温度との関係では第2図に示すことく、Te、Se およびBi の場合は曲線a、b間に挟まれる範囲I内で、これら金属の種類。組合せにより種々に変えることができ、Au、Ag、

Cu、Pd およびPt の場合は曲線。、f に挟まれる範囲 II 内で変えることができ、AL、Si、Ge、Ga およびSn の場合は曲線におよびdで挟まれる範囲II 内で変えることができる。さらに、範囲I、II およびII の相転移温度を示す各クループの金属のうち、異徳範囲に属する金属の組合せを変えることによつて、120~160℃の範囲内において適当な範囲に転移温度をもつ合金を得ることができる。

上述の光テイスク記録媒体は、 情報を告さ込む場合は、記録階にパワーの高いレーザ光を照射して溶融させてから室礁に自然放冷させると、106℃/sec以上の冷却速度で急冷されて # 相に転移し、情報の誓き込みができると共に、 # 相の媒体にパワーの小さいレーザ光を照射すると現相へ相転移し情報は消去できるので、 記録媒体に再書き込みが可能になる。

く奥施例>

以下、本発明の代表的な実施例について説明 する。

#### 実施例1

## (a) 光ティスク記録媒体の作製

In およひ Sb をそれぞれ 3 0 重掛をおよび70 重撮めの割合で混合した器材を、石英るつぼ中 に入れ、高周波加熱炉中で 6 4 5 ℃に加熱溶融 した後、炉内自然放冷して In<sub>0.3</sub>Sb<sub>0.7</sub>材料を得 ることができた。

次いて、第3図に示すように、ベルシャ1内 上部に径20 cmのポリメチルアクリレート(以 下、「PMMA」という。)製円板2を支持器3 て保持すると共に、ベルシャ1内に、上 配 工 程で得られた In u.3 Sb 0.7 材料 4 を入れたシル コニア製るつ任5、電子ビーム発生源6を配置し、排気整備7によりベルジャ1内を1×10<sup>-4</sup> ~1×10<sup>-5</sup> Torrに排気し、電子ビーム発生原6からるつ任5内のIn o.3 Sb o.7 材料 4 に電子ビームを照射し、In 0.3 Sb o.7 を蒸発させた。ついて、ベルツャ1内を常圧にもどし、円板2を自然放冷した。 得られた PMMA円板 2 (以下、「試料 Mu 1 」という。)上の In<sub>0.3</sub> Sb<sub>0.7</sub> 合金膜の膜摩を削 定したところ 2 5 0 Å であつた。

#### (b) 光ディスク 記録媒体の性能

上述の工程によつて得られた試料 No. 1 の In<sub>0.8</sub> Sb<sub>0.7</sub> 合金膜面を上に向け、第 4 図に示する き込み・再生要配によつて性能を測定した。

第4図に示す智き込み・再生装置において、智き込み側は、情報入力源10、智き込み制御 装置11、GaAs 半導体レーザ12、集光レンズ13、ミラー14からなつており、試料への 智き込み時のGaAs 半導体レーザの光出力は8 mW で行つた。

再生側は、 GaAs 半導体レーザ 1 5、 級光レンズ 1 6、 ビームスプリンタ 1 7、 トラツギングミラー 1 8、 光検出器 1 9、 再生出力制御装置 2 0、 テレビモニタ 2 1 とからなつており、上述の GaAs 半導体レーザ 1 2 の光出力で発き込まれた配録を、 GaAs 半導体レーザからの光出力を 0.8 mW にして、光検出器 1 9 に得られる

## 特開昭 60-177446 (4)

再生伯号を再生裝置20を介して搬送放対雑音比(以下、「C/N 比」という。)を調べたと とろ55分であつた。

さらに、上記 C / N 比 脚定終了後、 試料 M 1 の 情報 街 き 込 み 面 を 、 出 力 4 m W の G a A 5 半 場体 レー ザ 光 で 走 強 し た と こ ろ 、 街 き 込 み 情 報 を 消 去 す る こ と が で き た。

#### 與 施 例 2

蒸発源として Ino.45 Sbo.55 材料を用いた他は 実施例 1 と同様の方法で PMMA円板上に、250 A 厚の Ino.45 Sbo.55 合金膜を形成した試料を得 た。 この試料 M 2 について、実施例 1 と同じ方 法にしたがつて、 C/N 比を 測定したところそ の値は 5 5 多であつた。 また、 この試料 M 2 に 健 き込まれた情報は、 5 mW の GaAs 半導体レーザが試料面を走査することによつて消去する ことができた。

#### 奖施例3

蒸発源として、それぞれ(In<sub>0.45</sub>Sb<sub>0.55</sub>)<sub>0.9</sub>Au<sub>0.1</sub>、(In<sub>0.3</sub>Sb<sub>0.7</sub>)<sub>0.9</sub>Au<sub>0.1</sub>、(In<sub>0.2</sub>Sb<sub>0.8</sub>)<sub>0.8</sub>Au<sub>0.2</sub>、

 $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Au_{0.1}, (In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.8}Ag_{0.2},$  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$ ,  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.8}Cu_{0.2}$ , (In<sub>0.3</sub>Sb<sub>0.7</sub>)<sub>0.8</sub>Ag<sub>0.2</sub>, (In<sub>0.2</sub>Sb<sub>0.8</sub>)<sub>0.8</sub>Ag<sub>0.2</sub>, (Ino.45 Sbo.55)0.8 Pdo.2 (Ino.3 Sbo.7)0.8 Pdo.2 . (Ino.2Sbo.8)0.8Pdo.2 (Ino.45Sbo.55)0.9Pto.1.  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Pt_{0.1}$ ,  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Pt_{0.1}$ , (Ino.45 Sbo.55)0.9 ALO.1. (Ino.3 Sbo.7)0.9 ALO.1.  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}AL_{0.1}$ ,  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Si_{0.1}$ ,  $(In_{0.3}Sb_{0..7},)_{0.9}Si_{0.1}, (In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Si_{0.1},$  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Ge_{0.1}$ ,  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Ge_{0.1}$ ,  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Ge_{0.1}, (In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Ga_{0.1},$ (Ino.3Sbo.7)0.9Gao.1. (Ino.2Sbo.8)0.9Gao.1.  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Sn_{0.1}$ ,  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Sn_{0.1}$ ,  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Sn_{0.1}$ ,  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Te_{0.1}$ ,  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Te_{0.1}$ .  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Te_{0.1}$ .  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Bi_{0.1}$ ,  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Bi_{0.1}$ , と 向 様の 合金 膜 蒸 樹 方 法 および C / N 比 側 定 方 法によりC/N 比を測定したととろ、いずれも その値は55%であつた。

#### 奥施例4

奥施例1、2、3によつて作製された各試料を、蒸溜額の材料4としてMgFiを用いた以外は第3図と同じ装置および方法によつて、各試料の合金膜上に保護膜としてMgFiの蒸溶膜を1,000Å~2,000Å厚に被齎させ、第4図の装置によつてC/N 比を測定したところ、書き込みレーサ出力を10~13mWにし、消去時には5~8mWであり、記録再生には1~1.5mWを必要とすることが判つた。

また、C/N 比は55あて、保護膜を被滑しないものと同じことが判つた。

また、本英施例の保護與は Mg F : を使用したものについて説明したが、他の弗化物 Ce F : 、A L F : 又は Te O : 、V : O : 、V : O : 、Ti O : 、Si O : などの酸化物膜を保護として形成させた場合にも、同様の結果を得た。

上記典施例において、PMMA契円板上への (In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-y</sub>M<sub>y</sub> 合金の热滑膜は真空蒸滑法に よつて被滑させる方法について説明したが、真 

#### く発明の効果>

以上の説明から明らかなように、本発明による光デイスク記録媒体は、

## 特問昭60-177446(5)

の条材の簡類、組み合せ割合を適当に選ぶことによつて相転移温度を 1 2 0 ℃~ 1 6 0 ℃の間で自由に選択できる。

CaAs 半海体レーザ(他のレーザであつてもよい)の8~13mWの光出力で情報の替き込みが可能であり、得られる再生信号のC/N比は55%程度であり、従来のTe、TeOxを使用した光テイスク記録媒体のC/N比が60%程度であるのに比べて必ずしも高いとは云い得ないが、哲き込んだ情報の安定性が高く、繰り返し再生できる。

#### 4. 図面の簡単を説明

第1 図は本発明の光デイスク記録媒体の  $In_{1-X}Sb_X$  合金の \* 相形成時の組成依存性と \*\*
相から混相への相転移温度との関係を示す特性
図、 第2 図は (In<sub>1-X</sub>Sb<sub>X</sub>)<sub>1-Y</sub>M<sub>Y</sub> 合金における \*\*
相形成の組成依存性と \*\* 相から混相への相転移 温度との関係を示す特性図、 第3 図は実施例の 光ディスク記録媒体作製に使用する真空装置の 紙略構成図、 第4 図は実施例の光ディスク記録 媒体の性能測定に利用したむき込み・再生要能 の概略格成図である。

图面中、

1 … ベルシャ、

2 ··· PMMA 基 板、

4 … 蒸 看 材 科、

10… 悄報入力源、

12,15 ··· GaAs 半導体レーザ、

17…ビームスプリック、

19 … 光検出器、

20…再生出力制御装置、

21…テレビモニタ。

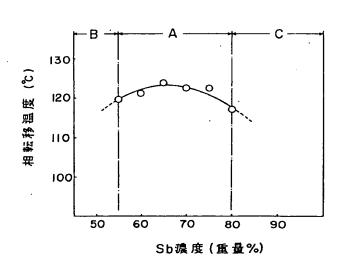
#### 特許出願人

日本電信電點公社

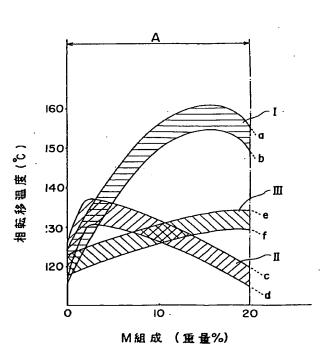
代理人

弁理士 光 石 士 郎 他1名

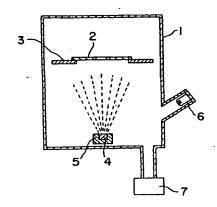
# 第 1 図



## 第 2 図



# 第 3 図



## 第 4 図

